



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2013148902/07, 05.11.2013

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 05.11.2013

(43) Дата публикации заявки: 10.05.2015 Бюл. № 13

Адрес для переписки:

125438, Москва, ул. Онежская, 8, ГНЦ РФ-
ФГУП "Исследовательский Центр имени М.В.
Келдыша", Самойловой Наталье Александровне

(71) Заявитель(и):

Государственный научный центр Российской
Федерации - федеральное государственное
унитарное предприятие "Исследовательский
Центр имени М.В. Келдыша" (RU)

(72) Автор(ы):

Полянский Михаил Николаевич (RU),
Игнатьев Сергей Сергеевич (RU)

(54) ПЛАЗМАТРОН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ДИНАМИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ**(57) Формула изобретения**

Плазматрон для нанесения покрытий, содержащий катод с цилиндрической термоэмиссионной вставкой, сопло-анод, изолятор, завихрительный блок с тангенциальными отверстиями, канал одновременного ввода плазмообразующего газа и порошка, систему водоохлаждения, отличающийся тем, что цилиндрическая термоэмиссионная вставка катода выполнена в виде центрального тела сопла-анода, суммарная площадь поперечных сечений тангенциальных отверстий завихрительного блока равна площади щелевого зазора между стенкой сопла-анода и цилиндрической термоэмиссионной вставкой катода, конец которой совпадает с началом расширяющейся сверхзвуковой части сопла-анода.